

成都真空设备厂家 surpass大口径等离子刻蚀机 半导体刻蚀 离子束刻蚀 反应离子刻蚀 可定制

产品名称	成都真空设备厂家 surpass大口径等离子刻蚀机 半导体刻蚀 离子束刻蚀 反应离子刻蚀 可定制
公司名称	成都汉普升科技有限公司
价格	1000000.00/套
规格参数	
公司地址	四川省成都经济技术开发区（龙泉驿）车城西二路288号派瑞国际4栋5楼
联系电话	13683458179

产品详情

本设备主要用于半导体刻蚀，能够兼容离子束刻蚀和反应离子刻蚀功能，使用气态化学刻蚀剂与材料产生反应来进行刻蚀，并形成可从衬底上移除的挥发性副产品，通过真空系统排出，特别适合刻蚀熔融石英、硅、光刻胶、聚酰亚胺(PI)薄膜、金属等材料。